

ひとわざ(一技)名: φ500 大口径セラミックスの凹面研削 公差3μm

1. 概要

当社は、半導体製造装置の大口径化(φ450クラス)を見据え、ロータリ研削加工の技術と、最大φ500mmのワークを測定できる平面度・平行度測定装置を開発・導入しました。

初期の試作開発に向けに形状の作り込みが容易で、多品種少量に幅広く対応したシステムです。

◆ φ500大口径セラミックス研削技術

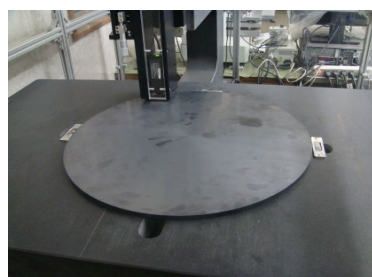
- ・ 大口径セラミックス(最大φ500mm)を、寸法公差±3μmで研削します。
- ・ 凹面研削、平面研削が可能です。
- ・ 当社が所有するロータリ研削盤の加工技術を、最大φ500mmの測定ができる平面度・平行度測定装置で検証済みです。凹面形状をトライ&エラーで作り込むことができます。

写真・図(要点説明)

凹面形状の作り込みが可能なロータリー研削盤



最大φ500mmが測定可能な平面度・平行度測定装置

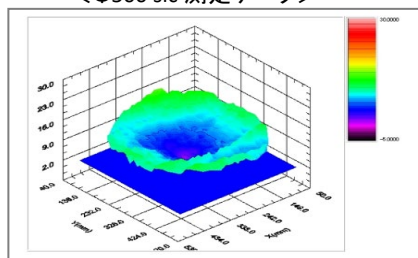


測定物: φ500sic平面研削加工 12μm凹面仕上げ

<研削仕上げによる表面状態(実績値)>

- ・ SiC : Ra ≤ 0.03
- ・ SiO₂ : Ra ≤ 0.05
- ・ Si : Ra ≤ 0.05
- ・ LTCC : Ra ≤ 0.08

<φ500 sic 測定データ>



2. 企業概況

フリガナ	サンリツテクノ カブシキカイシャ	フリガナ	イシイマ サノリ
会社名	サンリツテクノ株式会社	代表者名	石井 昌典
		フリガナ	イシイマ サノリ
事業内容	受託加工	窓口担当	石井 昌典
主要製品	セラミックス・ガラス・結晶材料の精密微細加工		
フリガナ	ヤマナシケン フェフキシ イサワチヨウ イド		
住所	〒406-0045 山梨県笛吹市石和町井戸211-4		
電話/FAX	055-263-7632 / 055-263-7527	E-mail	info@sanritsutechuno.co.jp
資本金(百万円)	15	設立年月	1970年7月
		売上(百万円)	200
		従業員数	27

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他

切断・研削・研磨・穴あけ等の精密機械加工を得意とし、チャレンジ的な加工にも積極的に取り組んでいます。チャンピオン1個の製作から、製品の作り込み、開発から量産化までをサポートします。